

С 361

Ю. 896

ОБЪЕДИНЕННЫЙ
ИНСТИТУТ
ЯДЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Дубна

OPTT, 1966, Т. 8, б. 9,

с. 2527 - 2531.

P - 2282



Издательство
Научных Программ

Лаборатории

Л. Г. Юскеселиева, А. С. Антонов

ЭЛЕКТРОФОТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ
ЛИТИЯ В КРЕМНИИ р-ТИПА

1965

I. Введение

Электрофотографический метод определения коэффициента диффузии лития в кремниевых монокристаллах р-типа заключается в одновременном измерении границ электронно-дырочного перехода и области отрицательного пространственного заряда в диффузионном р-п-переходе в двух образцах с различной начальной проводимостью. Для вычисления коэффициента диффузии применяется формула Фуллера^{1/}, однако экспериментальные данные получены совершенно иным способом - с помощью электрофотографии.

Если в полупроводник р-проводимости с концентрацией акцепторов N_a вводится донорная примесь путем диффузионного отжига из тонкого слоя диффундирующего вещества (нанесенного на одну из поверхностей "полубезграничного" образца), то распределение концентрации доноров описывается уравнением:

$$N_D(x, t) = N_0 \operatorname{erfc} \left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}} \right), \quad (1)$$

где N_0 - концентрация доноров на поверхности, а $\operatorname{erfc} z = 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-\lambda^2} d\lambda$.

При $N_D = N_a$ из уравнения (1) (см. рис. 1) получаем:

$$N_a = N_0 \operatorname{erfc} z, \quad (2)$$

$$\text{где } z = \frac{x_0}{2\sqrt{Dt}}.$$

Если в двух образцах с разными концентрациями акцепторов - N'_a и N''_a (где $N''_a > N'_a$) введена донорная примесь, то из уравнения (2) нетрудно составить следующее соотношение:

$$\frac{N'_a}{N''_a} = \frac{\operatorname{erfc} z'}{\operatorname{erfc} z''}, \quad (3)$$

где $z' = \frac{x'_0}{2\sqrt{Dt}}$, $z'' = \frac{x''_0}{2\sqrt{Dt''}}$, а x'_0 и x''_0 - расстояния от граничной поверхности до электронно-дырочного перехода в первом и втором образце соответственно.

Пользуясь экспериментальными данными для глубины залегания диффузионного р-п-перехода в двух образцах (x'_0 и x''_0) для параметра $b = \frac{N''_a}{N'_a}$ и зная времена диффузии t' и t'' (обычно $t' = t''$), мы вычислили из отношения (3) коэффициент диффузии D (при этом предполагалось, что он одинаков для двух образцов).

Уравнение (3) решено нами графически. Графическое решение представлено на рис. 2, где по оси ординат отложено отношение $\frac{z'}{z''} = \frac{x'_0}{x''_0}$, а по оси абсцисс — величина $z' = \frac{x'_0}{2\sqrt{Dt}}$. Отдельные кривые построены при разных значениях параметра $b = \frac{N''_a}{N'_a}$.

II. Описание нового метода

Новый экспериментальный метод для определения коэффициента диффузии лития в кремнии с помощью электрофотографии можно разделить на два этапа: а) определение глубин залегания р-п-переходов (x'_0 и x''_0) и б) определение отношения концентраций акцепторов ($b = \frac{N''_a}{N'_a}$).

1. Определение глубин залегания электронно-дырочных переходов x'_0 и x''_0

Глубина залегания электронно-дырочного перехода определялась путем выявления границы перехода электрофотографическими проявителями^{2,3/}. Р-п-переход был проявлен последовательно с помощью сухого позитивного электрофотографического проявителя (рис. 3), с помощью сухого негативного проявителя (рис. 4) и с помощью жидкого позитивного проявителя (рис. 5). Полученные по трем способам результаты для расстояния от граничной поверхности до диффузионного р-п-перехода (x_0) усреднялись и сравнивались с результатами, полученными с помощью электрохимического отложения меди^{4/}. Ошибки измерения по методу электрофотографии и по методу электрохимического отложения меди одинакового порядка и меньше 10 мкм.

2. Определение отношения концентраций акцепторов $b = N''_a/N'_a$

Отношение концентраций акцепторов в двух образцах (см. уравнение (3)) определялось путем выявления области отрицательного пространственного заряда в р-п-переходе с помощью жидкого электрофотографического проявителя^{3/}.

Образец зажимался в оправе между tantalовыми электродами таким образом, что торцевая поверхность находилась в вертикальном положении, и р-п-переход происходил ближе к верхнему электроду. К образцу прикладывалось обратное напряжение U в течение 5 минут. Не выключая напряжения, на заранее тщательно отшлифованную торцевую поверхность образца наносилась «капля сильного разреженного» (100 мг. л⁻¹) жидкого электрофотографического проявителя. Коллоидные частицы проявителя, несущие положительный заряд, оседали в области отрицательного пространственного заряда диффузионного р-п-перехода. Полученная для данного обратного

напряжения полоса отрицательного пространственного заряда измерялась микроскопом. После этого отложившийся электрофотографический проявитель удалялся с торцевой поверхности ватой, смоченной спиртом, и процесс проявления повторялся при другом значении напряжения. Для каждого образца область отрицательного пространственного заряда проявлялась в интервале напряжений от 1,3 до 80 в (рис. 8).

Толщина δ - области отрицательного пространственного заряда диффузионного р-п-перехода в случае, когда переход залегает не очень глубоко от поверхности кристалла, связана с приложенным напряжением U зависимостью^{/5/}:

$$U + U_k = \frac{2\pi e \cdot N_a}{\epsilon} \delta^2, \quad (4)$$

где U_k - потенциальный барьер в р-п-переходе, ϵ - диэлектрическая проницаемость полупроводника, a - заряд электрона.

Полученная экспериментальная зависимость $U = U(\delta^2)$ является линейной для всех образцов (рис. 7). Построив графически эту зависимость для двух образцов с разными концентрациями акцепторов N'_a и N''_a , можно легко найти с помощью уравнения (4) параметр b .

Значения параметра b , полученные путем электрофотографического проявления области отрицательного пространственного заряда, были сравнены со значениями, полученными из измерения специфического сопротивления (из выражения $b = \frac{N''_a}{N'_a} = \frac{\rho'}{\rho''}$, выведенного при предположении, что все акцепторные примеси полностью ионизированы), и из измерения ёмкости диффузионного р-п-перехода^{/5/}. Результаты сравнения приведены в таблице 1. Видно, что по трем методам получаются близкие значения.

Ошибка измерения толщины области отрицательного пространственного заряда δ с помощью электрофотографического метода составила 5 мкм.

III. Вычисление коэффициента диффузии

Коэффициент диффузии лития в кремнии р-типа был вычислен из графического решения уравнения (3) (см. рис. 2) путем использования экспериментальных данных для глубин залегания диффузионных р-п-переходов (x'_0 и x''_0) и для параметра $b = \frac{N''_a}{N'_a}$, полученных электрофотографическим способом.

Измерения проводились на легированном бором монокристалле р-кремния с удельным сопротивлением $50 \div 1000$ ом·см и с временем жизни основных носителей $50 \div 300$ мкsec. Образцы представляли собой пластики толщиной $1 \div 6$ мм и диаметром $10 \div 30$ мм, отрезанные от слитка перпендикулярно направлению (111).

После шлифовки и травления в СР - 4 на одну из поверхностей образца наносился тонкий слой лития путем испарения в вакууме. Диффузия лития проводилась в атмосфере аргона при температурах 180 - 500°С в течение 3 - 30 мин. Затем торцы образца травились снова и на обе стороны напылялись алюминиевые электроды.

Результаты, полученные для коэффициента диффузии лития в кремнике р-типа, представлены на рис. 8. В исследуемом температурном интервале коэффициент диффузии можно представить следующей эмпирической формулой:

$$D = 21 \cdot 10^{-4} \exp \left(-\frac{13000}{RT} \right) \text{ см}^2/\text{сек}$$

где $R = 1,98$ кал/град - универсальная газовая константа.

Для сравнения приведем результаты Фулера и Северинса, полученные ими путем измерения подвижности ионов лития в кремнике р-типа:

$$D = 19 \cdot 10^{-4} \exp \left(-\frac{14700}{RT} \right) \text{ см}^2/\text{сек}$$

$$D = 23 \cdot 10^{-4} \exp \left(-\frac{15200}{RT} \right) \text{ см}^2/\text{сек.}$$

По методу электрофотографии получаются результаты, близкие к результатам Фулера и Северинса.

IV. Выводы

В отличие от существующих методов для определения коэффициента диффузии примесей в полупроводниках^{8/} электрофотографический метод обладает исключительной простотой и несложностью техники эксперимента. Этот метод, в принципе, может быть применен для исследования диффузии примесей в других полупроводниках в случаях, когда вводимая примесь образует диффузионный р-п-переход.

Таблица 1

Отношение концентраций акцепторов $b = \frac{N''_a}{N'_a}$ в нескольких парах образцов кремния

Номер пары образцов	b		
	По электрофото- графии	По специфическому сопротивлению	По измерению емкости
2	1,79	1,84	2,25
3	2,08	2,18	1,88
5	3,03	4,02	-
1	3,84	2,08	2,84
4	4,58	3,42	-

Л и т е р а т у р а

1. C.S.Fuller. Phys.Rev., 86, 1, 136 (1952).
2. А.С.Антонов, Л.Г.Юскеселиева. Препринт ОИЯИ 2232, Дубна 1985 г.
3. А.С.Антонов, Л.Г.Юскеселиева. Препринт ОИЯИ Р-2002, Дубна 1985 г.
4. А.С.Антонов, Б.П.Осипенко, Л.Г.Юскеселиева. Препринт ОИЯИ Р-1726, Дубна 1984 г.
5. Л.С.Берман. Нелинейная полупроводниковая ёмкость. Физматгиз, Москва, 1983.
6. T.C.Severiens, C.S.Fuller. Phys.Rev., 92, 5 (1953).
7. C.S.Fuller, J.C.Severiens. Phys. Rev., 96, 1 (1954).
8. Б.И.Болтакс. Диффузия в полупроводниках. Физматгиз, Москва, 1981.

Рукопись поступила в издательский отдел
17 июля 1985 г.

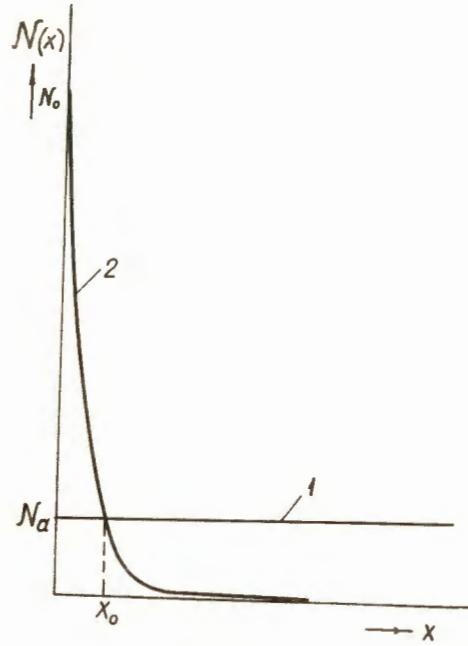


Рис. 1. Распределение концентрации акцепторов (кривая 1) и доноров (кривая 2) после диффузии литья в кремний p-типа.

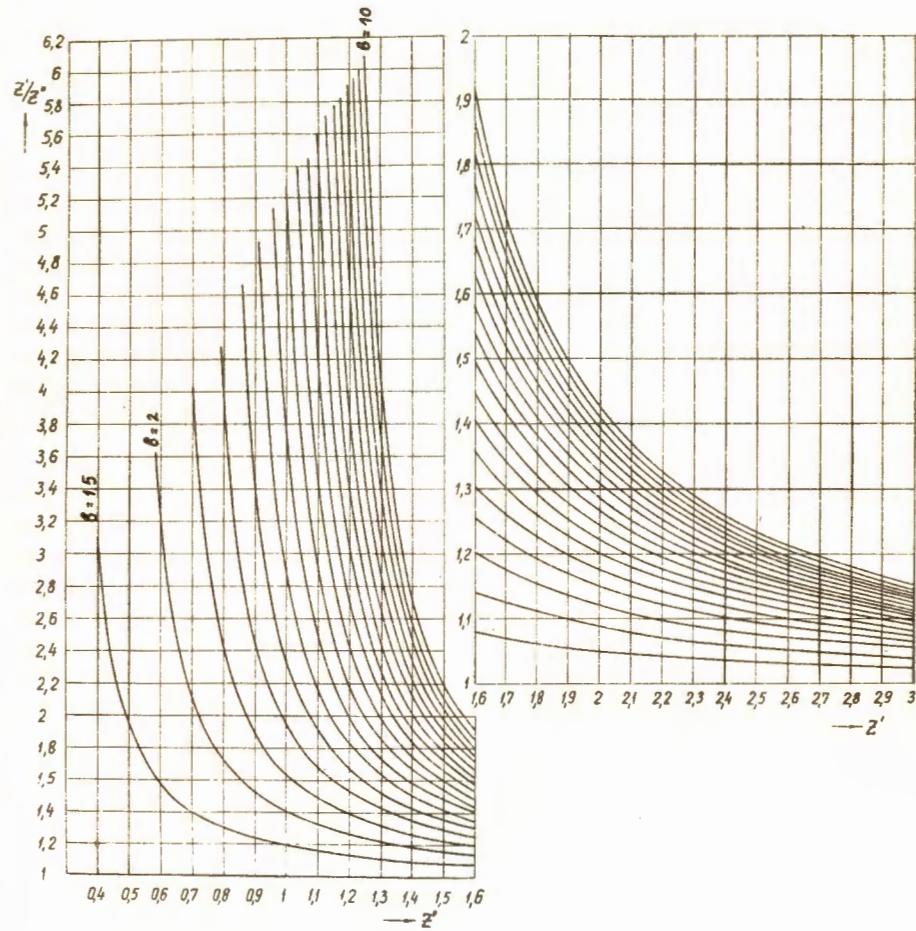


Рис. 2. Графическое решение уравнения $\frac{1}{b} = \frac{\operatorname{erfc} z'}{\operatorname{erfc} z''}$. Кривые построены при значениях параметра b в интервале от 1,5 до 10 через 0,5.

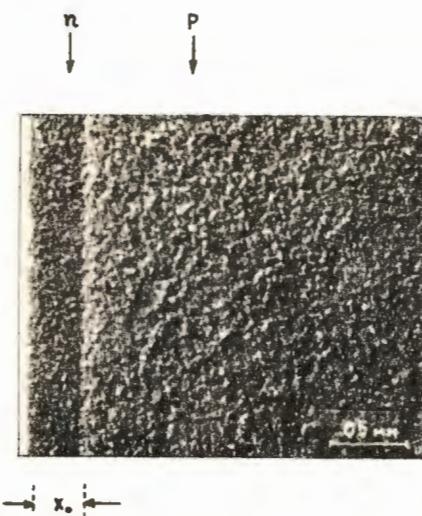


Рис. 3. Картина диффузионного р-п-перехода в кремний р-типа, полученная сухим позитивным электрофотографическим проявителем.



Рис. 4. Картина диффузионного р-п-перехода в кремний р-типа, полученная сухим негативным электрофотографическим проявителем.



Рис.5. Картина диффузионного р-п-перехода в кремний р-типа, полученная жидким позитивным электрофотографическим проявителем.

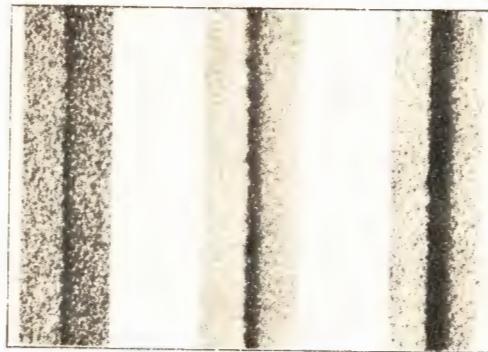


Рис. 6. Область отрицательного пространственного заряда р-п-перехода в кремний р-типа, проявленная жидким позитивным электрофотографическим проявителем при напряжениях обратного смещения:
а) $U = 2,8$ в; б) $U = 39$ в; в) $U = 76$ в.

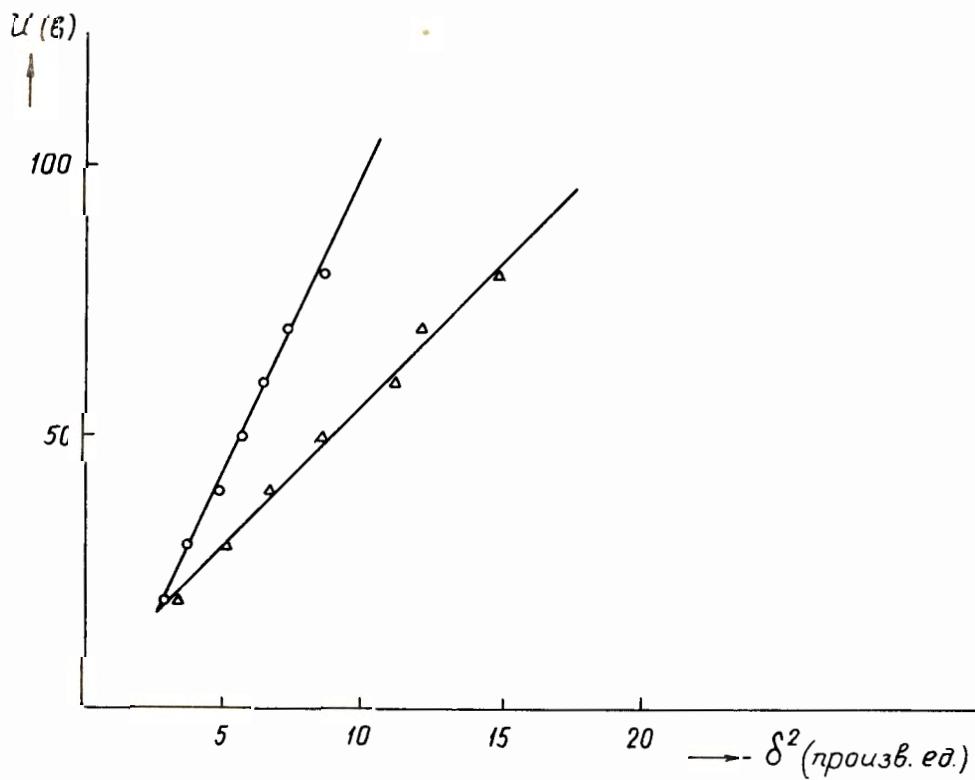


Рис. 7. Зависимость напряжения обратного смещения U от квадрата толщины области отрицательного пространственного заряда δ^2 для двух кремниевых образцов.

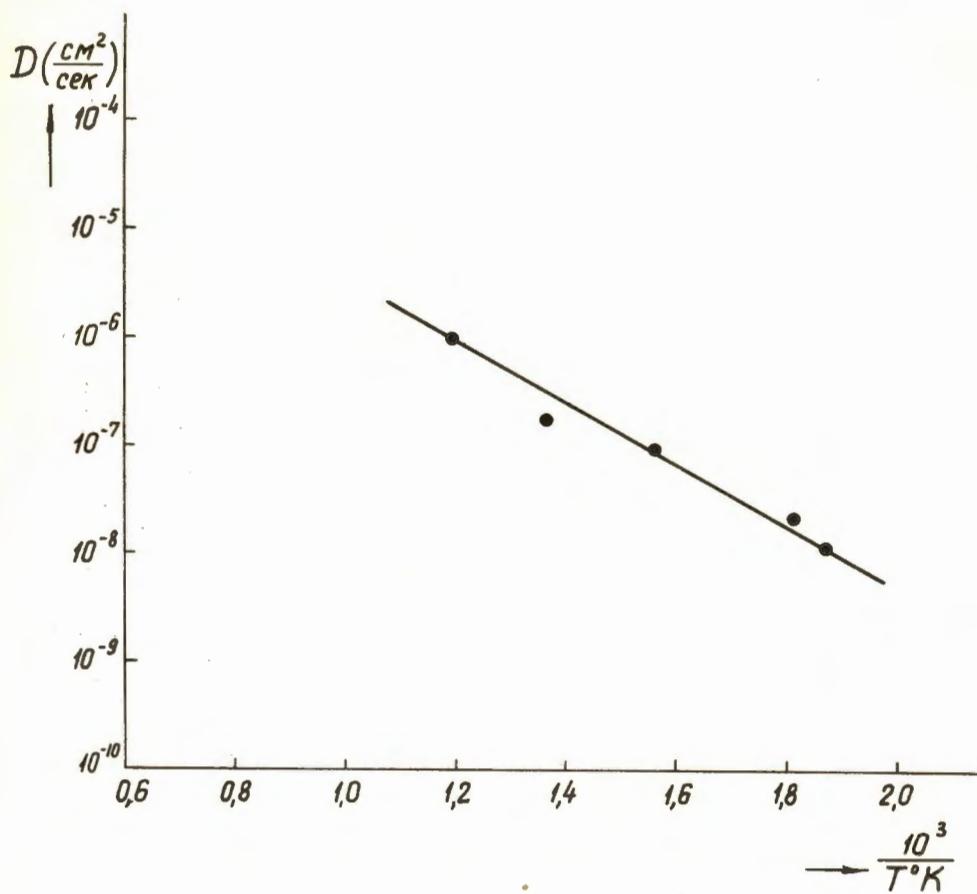


Рис. 8. Экспериментальная зависимость коэффициента диффузии лития в кремнии р-типа от температуры.